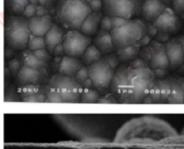
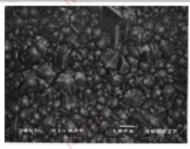


# **Ceramic CVD Reactor**

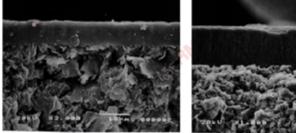
Dynamic ThermVac in pursuit of

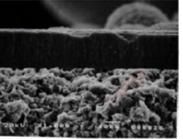
the Best Vacuum Furnace

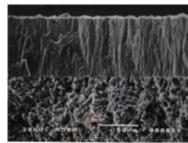












# [썸백 CVD 장비 특장점]



2400℃ 초고온까지의 CVD 요구에 대응하는 Hot Zone



제품 적재조건에 따라 수평, 수직 Gas Flow 모두 가능



유지보수가 용이한 Muffle, Nozzle 및 배관 구조



가스공급 ~ 배기처리 Scrubber 전라인 Turn Key 공급



각부 수명/유지보수주기 연장을 위한 각종 고안



### [썸백 CVD 장비 응용범위]

#### 막재 질

- ① SiC, TaC, HfC, BN
- ② Carbon



### 온도 압력

- ① 950 ~ 2,400°C
- ② 133 Pa ~ 100 KPa



#### 공 정

- ① CVD
- ② CVI (TG, ISO, Pulsed)

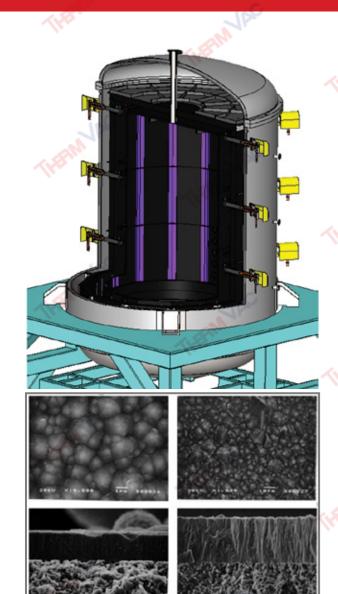
**THERM VAC** 

TERM

# M

THERMVAC

### [세라믹 CVD 표준공통사양]



- ▶ 장비 형식 : 수직형 고온 화학기상증착 반응장치
- ▶ 장비 용도 : 세라믹 막 증착(CVD) 또는 치밀화 함침(CVI)
- ▶ 합성 재료 : SiC, TaC, HfC, BN, (Pyrolitic) Carbon
- ▶ 적재 공간 : 254L ~ 3532L
- ▶ 사용 온도 : 고온형[Max. 1600°C], 초고온형[Max. 2400°C]
- ▶ 온도 분포도: ± 6~12℃ [1000℃, No Load, Vacuum]
- ▶ 승온 속도 : 2~10°C/min
- ▶ 온도 제어 : 열전대와 SCR에 의한 Multi Zone PID 제어
- ▶ 가열실 재료 : Graphite
- ▶ Retort Muffle 형식 : 다각조립형 Graphite 원통
- ▶ 공정 가스 : Source[MTS, CH<sub>4</sub>, TaCl<sub>5</sub>, HfCl<sub>4</sub>, BCl<sub>3</sub>-NH<sub>3</sub>], H2, N2, Ar
- ▶ 공정 압력 범위 : 5KPa ~ 50KPa
- ▶ 진공 배기 : Mechanical Booster Pump + Dry Pump
- ▶ 제품 장입 : 승강식 하부도어 장입, 턴테이블 회전
- ▶ 도어 잠금 방식 : 유압 클램프 잠금 방식
- ▶ 배기 처리 : 응축 Trap, 분진 Filter, Scrubber
- ▶ 시스템 제어 : PLC Control, PC or Touch Panel Operation
- ▶ Electric Power : AC 3Ф 또는 DC



# [세라믹 CVD 표준제작규격]

#### 고온형(HT)\_Max. 1,600℃

모델명	TVCVD-HT0609	TVCVD-HT1015	TVCVD-HT1218	TVCVD-HT1520
장입 규격 (mm)	Ф600*900Н	Ф1000*1500Н	Ф1200*1800Н	Ф1500*2000Н
장입 중량 (Kg)	200~300Kg	550~700Kg	750~1000Kg	1000~1300Kg
온도 분포도	±6℃	±8°C	±10℃	±12℃
가열 전력 (KVA)	360KVA	600KVA	750KVA	1000KVA

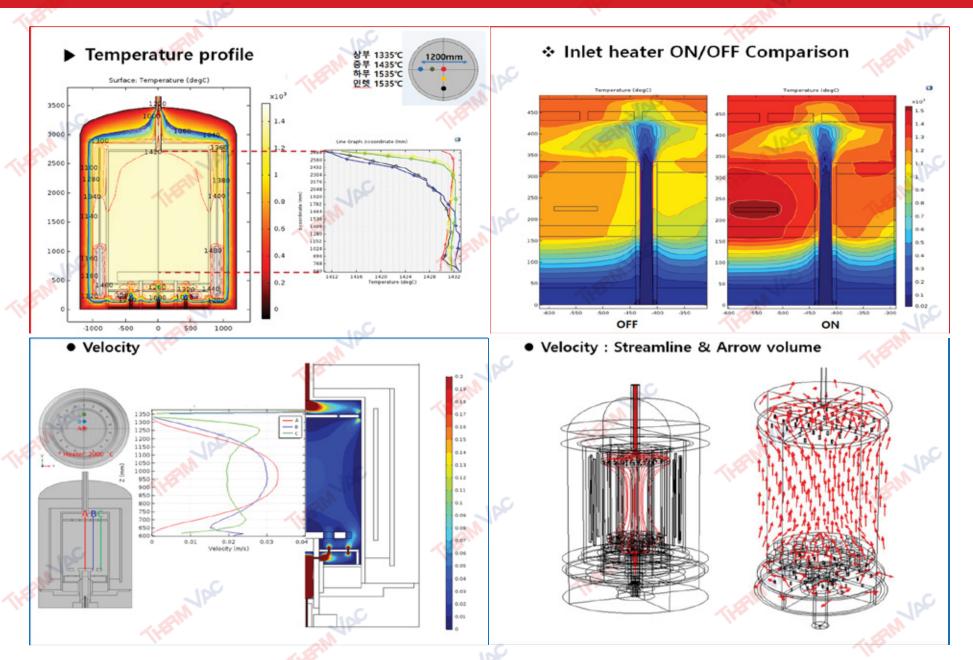
#### 초고온형(UT)\_Max. 2,400℃

_					
	모델명	TVCVD-UT0609	TVCVD-UT1015	TVCVD-UT1218	TVCVD-UT1520
	장입 규격 (mm)	Ф600*900Н	Ф1000*1500Н	Ф1200*1800Н	Ф1500*2000Н
	장입 중량 (Kg)	200~300Kg	550~700Kg	750~1000Kg	1000~1300Kg
	온도 분포도	±6℃	±8℃	±10℃	±12℃
	가열 전력 (KVA)	540KVA	940KVA	1140KVA	1440KVA





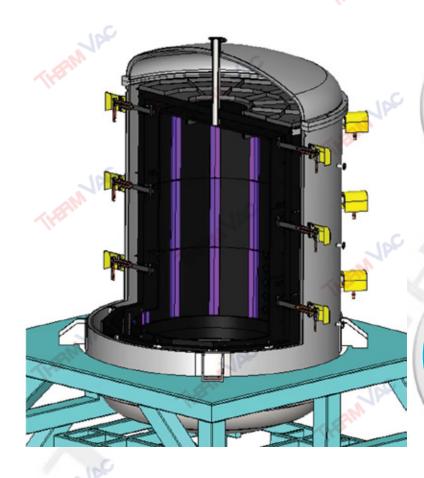
### [Carbon CVD/CVI Simulation]





**THERM VAC** 

### [CVD 세부사양구성\_진공챔버]



환경 해석 ▶ 단열재 외벽 온도 : 300~600℃

▶ 압력: 내부 – 진공 / 외부 – 대기압

▶ 수냉 쟈켓 압력

냉각수 압력 - 3Kg/cm²

내부 진공 압력 - 1Kg/때

▶ 형식 : 하부 장입 수직 원통형

▶ 구조 : 수냉 이중벽

► 재질: 내벽: STS316L

외벽/플랜지: STS304

► 내벽표면처리 : Buffing #300

설계/ 제작

TERMVA

THE IN VAC

THE MAC



# [CVD 세부사양구성\_챔버품질보증]





### [CVD 세부사양구성\_가열실]

단열재



► 재질 : Graphite Rigid Felt

► 두께 : 고온형 80T, 초고온형 150T

히 터



► 재질 : Graphite CIP Block

▶ 발열회로 : 2 ~ 4 회로 분할

▶ 형식 측면 : 커넥터 + Rod 조립 원통형

하부 : 판재 가공 원반형

머 플

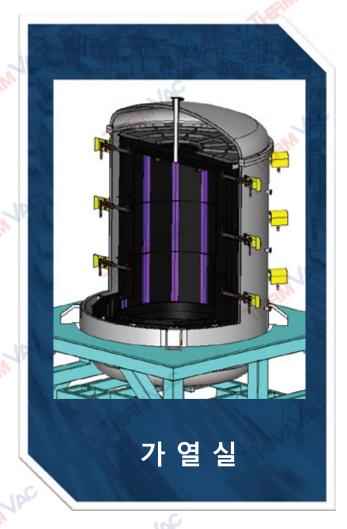


► 재질 : Graphite CIP Plate

▶ 형식 : 판재조립 다각원통형

▶ 체결부품 : 카본 복합재 나사

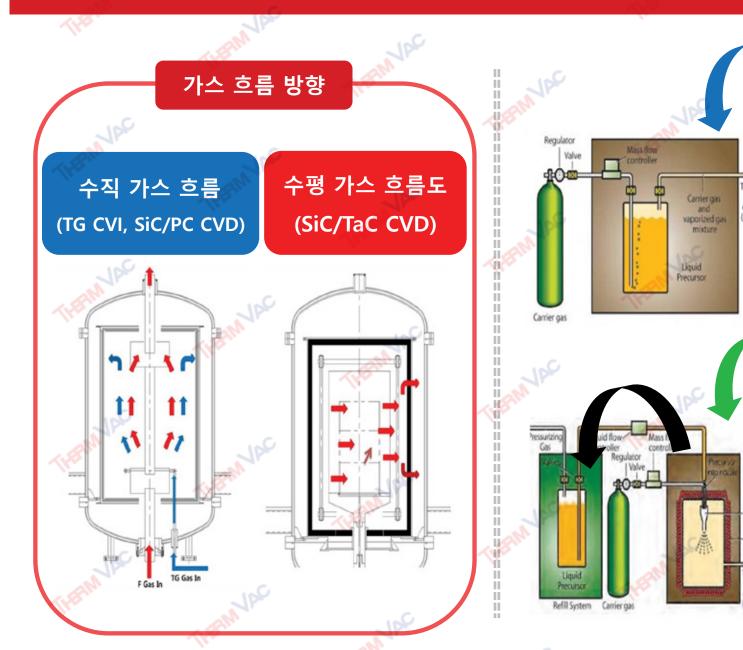
► 내벽처리 : Graphite Foil Lining



**THERM VAC** 



# [CVD 세부사양구성\_Gas Flow & Precursor]



Bubbler **System** Vaporization System





# [CVD 세부사양구성\_진공배기장치]





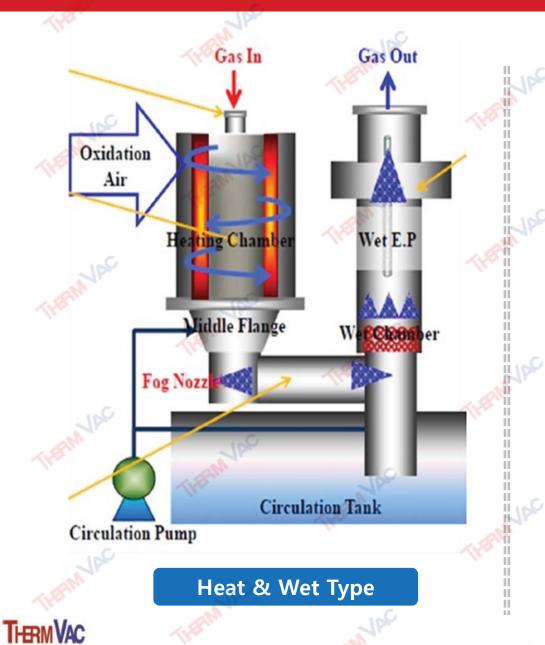


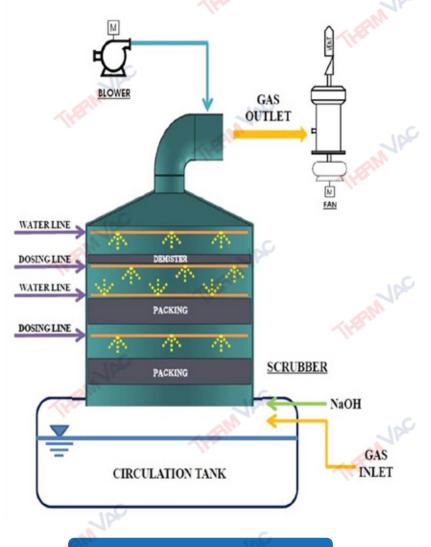
진공 펌프	진공 게이지	Dry Pump 보호 장치
► 전단펌프 : Mech. Booster Pump ► 후단펌프 : Screw Type Dry Pump	► Type : Diaphragm Manometer  ► Maker : MKS or Inficon	► 펌프전방 : 응축 트랩 + 분진 필터 ► 펌프내부 : 자체 세정 기능
► Maker : Edwards or Busch	▶ 측정점 : 머플 내, 머플 외, 배관 기타	▶ 펌프후방 : 스크러버 역류방지장치





### [CVD 세부사양구성\_스크러버]

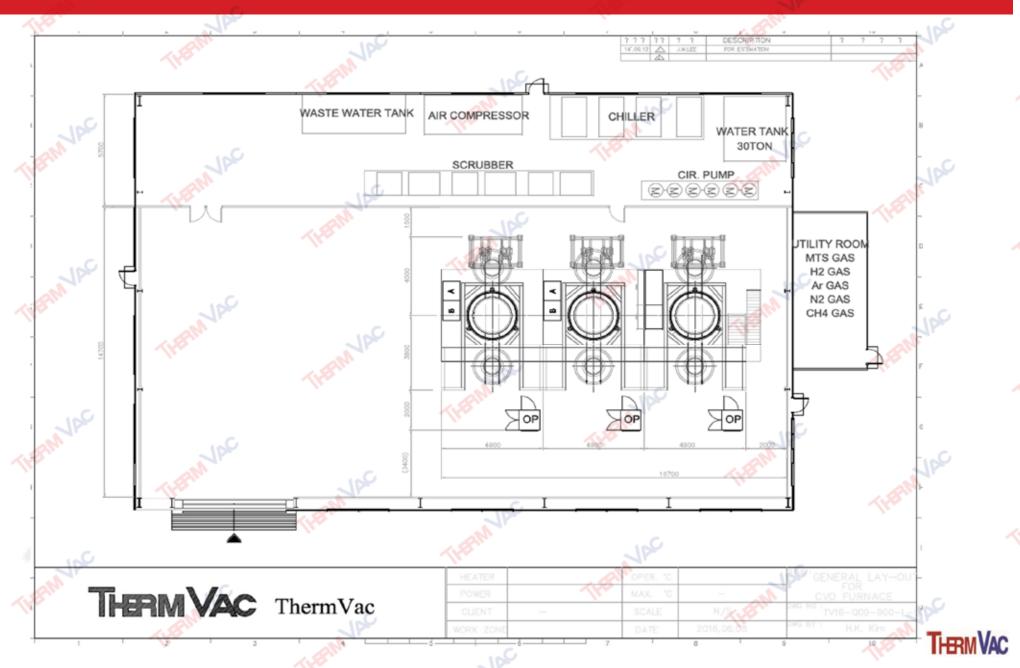




Dilution & Wet Type

M

# [CVD 세부사양구성\_배치도]

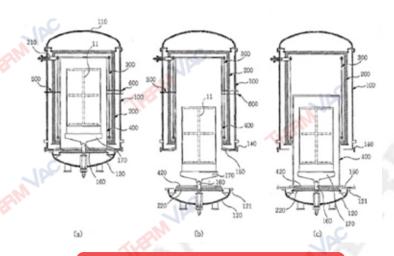




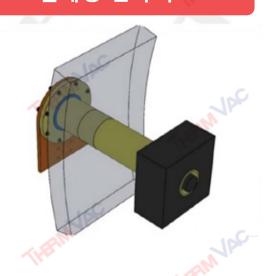
**THERM VAC** 

# [CVD 수명연장 및 유지보수 편의기구]

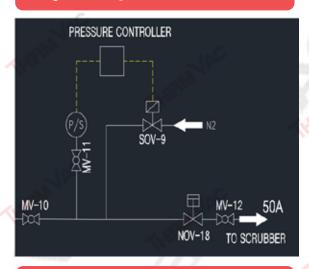
#### 머플 vs 가열실의 분리 구조



#### 밀폐형 전극 구조



#### Dry Pump 역류 오염 방지



#### 노즐 오염부 분해 구조





## [세라믹 CVD 납품실적]



한국 S사 [SiC CVD]



대양산업 [SiC/PC]



세라믹기술원 [SiC/HfC]



한국 T사 [TaC CVD]



전남테크노파크[SiC CVD]



DACC [Carbon CVI]



한국 K사 [SiC]



중국 A사 [SiC CVD]

